

Sektion für Optik und Elektronenmikroskopie

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **AssociationNews**

Zeitschrift: **Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft. Wissenschaftlicher und administrativer Teil = Actes de la Société Helvétique des Sciences Naturelles. Partie scientifique et administrative = Atti della Società Elvetica di Scienze Naturali**

Band (Jahr): **153 (1973)**

PDF erstellt am: **26.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

14. Sektion für Optik und Elektronenmikroskopie

Schweizerische Gesellschaft für Optik und Elektronenmikroskopie
Société Suisse d'Optique et de Microscopie électronique
Società Svizzera di Ottica e Microscopia elettronica

Präsident: Dr. L. Wegmann, Postfach 2, 9477 Trübbach
Sekretär: Dr. W. Stäubli, Ciba-Geigy AG, 4000 Basel

Wissenschaftliche Sitzung / Séance scientifique

Samstag, 20. Oktober / Samedi 20 octobre

1. P. Stucki (IBM Research Laboratory, Zürich): Digitale Bildverarbeitung
2. G. Herziger (Institut für angewandte Physik der Universität Bern): Laser-Materialbearbeitung
3. C.J. Humphreys (Department of Metallurgy, University of Oxford, UK): Applications of High Voltage Electron Microscopy to Solid State Physics and Material Science
4. H. Ris (Department of Zoology, University of Wisconsin, Madison, Wisc., USA): Application of High Voltage Electron Microscopy in Biology
5. Th. Koller (ETH Zürich): Bericht über die EMBO-Arbeitstagung in Gais: The possibilities and prospects of obtaining high resolution information (below 30 angstrom) on biological material